12

# Изменение состава ионного тока в процессе полевого испарения вольфрама при высоких температурах

© О.Л. Голубев, Н.М. Блашенков

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, 194021 Санкт-Петербург, Россия e-mail: O.Golubev@mail.ioffe.ru

Поступило в Редакцию 3 октября 2018 г. В окончательной редакции 7 ноября 2018 г. Принято к публикации 5 декабря 2018 г.

С помощью магнитного секторного масс-спектрометра с полевым источником ионов и полевого эмиссионного микроскопа изучалось полевое испарение вольфрама при высоких температурах  $T \sim 2000$  К. В процессе испарения при высоких T наблюдались только низкозарядные ионы  $W^{+2}$  и  $W^+$  для всех изотопов W. При этом распределение величин ионных токов изотопов по массам примерно соответствовало стандартному изотопному отношению для природного вольфрама. Однако наблюдались и отклонения от стандартного изотопного отношения вследствие флюктуаций и нестабильного характера процесса испарения.

DOI: 10.21883/JTF.2019.07.47807.353-18

# Введение

Явление полевого испарения состоит в том, что поверхностные атомы эмиттера испаряются в виде положительных ионов только под воздействием сильного испаряющего электрического поля напряженностью Fev порядка нескольких десятков вольт на нанометр (обычно  $F_{ev} \sim 10-60 \, {\rm V/nm}$ ), известно это явление относительно давно [1]. Используется подобное явление обычно как метод получения идеальной атомарно-гладкой поверхности эмиттера в полевой ионной микроскопии, а также и как метод элементного анализа состава поверхности полевого эмиттера в атомных зондах [2]. Делаются в последнее время и попытки применения этого явления для создания точечных ионных источников [3]. Для создания сильного испаряющего электрического поля обычно используются эмиттеры-катоды из проводящего материала в виде острий с радиусом закругления в конце острия  $r \sim 50-150\,\mathrm{nm}$ , к аноду же прикладывается высокое постоянное напряжение  $U \sim 10-15$  kV, а в случае использования времяпролетных приборов наряду с постоянным напряжением прикладывается также и импульсное напряжение  $U \sim 0.2 - 0.3 \, \text{kV}$ . Было проведено достаточно много экспериментов по полевому испарению различных металлов, сплавов и сложных соединений, при этом было показано, что в случае испарения под воздействием электрических полей разных напряженностей возможно появление ионов разного заряда и состава, атомарных, молекулярных, комплексных. Однако никто и никогда не наблюдал какой-либо зависимости процесса полевого испарения от массы испаряемого изотопа, и это представляется естественным, поскольку, как хорошо известно, электростатическое поле дисперсией по массе не обладает. В качестве типичного примера можно отметить приведенный в работе [4] масс-спектр полевого испарения вольфрама, полученный

с помощью времяпролетного атомного зонда высокой разрешающей способности по массам при криогенной температуре эмиттера. Спектр показан для трехзарядных ионов W<sup>+3</sup> и для всех основных четырех изотопов вольфрама, при этом если стандартное изотопное отношение для вольфрама —  $^{182}$ W :  $^{183}$ W :  $^{184}$ W :  $^{186}$ W = 26.5 : 14.3 : 30.6 : 28.4, то экспериментальные результаты работы [4] по полевому испарению W показали изотопное отношение испаряемых ионов  $^{182}$ W:  $^{183}$ W:  $^{184}$ W:  $^{186}$ W = 26.3 : 12.9 : 31.1 : 29.7, т.е. практически совпадающее с природным изотопным отношением для W.

Таким образом, определенным выводом из всех предыдущих работ было утверждение, что действительно процесс полевого испарения связан прежде всего с величиной напряженности испаряющего Fev и с температурой эмиттера Т, но никак не связан с величиной массы испаряемого изотопа. Однако все проведенные эксперименты относились к полевому испарению при криогенных температурах  $T \leq 77$  K, при которых могут использоваться только очень сильные электрические испаряющие поля  $F_{ev} = 40 - 60 \, \text{V/nm}$ , когда внешнее электрическое поле снимает потенциальный барьер для испарения ионов практически до нуля, при этом самые тугоплавкие металлы могут испаряться с огромными скоростями даже при гелиевых температурах, и в процессе испарения наблюдаются только ионы наиболее высоких зарядов. Например, вольфрам при этом испаряется главным образом в виде ионов W<sup>+3</sup>, меньше испаряется ионов  $W^{+2}$  и  $W^{+4}$ , наблюдались даже ионы  $W^{+5}$  и  $W^{+6}$ , но никогда не наблюдались однозарядные ионы W<sup>+</sup> [1,2].

Если же использовать полевое испарение при достаточно высоких температурах T эмиттера, то ситуация становится принципиально иной. Нами был выполнен ряд работ по изучению полевого испарения некоторых металлов, сплавов и соединений при высоких  $T \ge 1000 \text{ K}$  [5–7]. Основными особенностями полевого испарения при высоких T было резкое понижение заряда испаряемого иона с ростом T вследствие заметного снижения величин испаряющих полей, а также появление заметной величины энергии активации процесса испарения вместо нулевых практически значений в случае испарения при криогенных T. Интересным явлением, которое наблюдалось при испарении при высоких T, был тот факт, что в ряде случаев изотопный состав ионного тока не соответствовал стандартному изотопному отношению для природного вольфрама. Для изучения изменений зарядов и масс изотопов испаряемых ионов нами и были проведены подробные эксперименты по полевому испарению вольфрама с контролем изотопного состава ионного тока.

## Техника и методика эксперимента

Эксперименты с полевыми эмиттерами в виде острий из вольфрама W проводились на двух различных приборах — комбинированном полевом эмиссионном микроскопе и на 60° статическом магнитном секторном масс-спектрометре с полевым источником ионов. Установка полевого эмиссионного микроскопа позволяла совмещать режимы полевого электронного микроскопа с пространственным разрешением порядка 3-5 nm, полевого ионного микроскопа с атомарным разрешением и полевого десорбционного (точнее — испарительного) микроскопа, разрешение которого составляет примерно 1-2 nm, но который позволяет наблюдать поверхность эмиттера непосредственно при высоких Т и в лучах испаряющихся собственных ионов эмиттера. Вакуум в установке микроскопов был на уровне  $p \sim 10^{-10}$  Torr. Величины напряженности электрического поля Fev и работы выхода  $\varphi$  могли определяться классическим методом Фаулера-Нордгейма [8], и при определении величины Fev величина  $\phi$  для W полагалась равной 4.5 eV. Вольфрамовые эмиттеры в виде острий малого радиуса кривизны изготавливались хорошо известными методами электролитического травления в растворе едкого натрия [1,2]. Что касается масс- спектрометрической установки с полевым источником ионов, то в нашем распоряжении имелся 60° магнитный секторный статический масс-спектрометр, который обладал разрешающей способностью по массам  $(m/\Delta m) = 200$ . Такая величина (*m*/ $\Delta m$ ) позволяла уверенно разрешать основные четыре изотопа вольфрама —  $^{182}$ W,  $^{183}$ W,  $^{184}$ W и <sup>186</sup>W (имеется еще один изотоп <sup>180</sup>W, но его содержание мало, около 0.126%). Полевой источник ионов этого прибора имел острие-эмиттер и соответствующую систему линз и щелей, характеристики данного источника подробно описаны в[9], и ионы образовывались за счет полевого испарения атомов поверхности эмиттера в виде ионов. Ионно-оптическая система источника позволяла изменять приложенное напряжение U (и соответственно электрическое поле у вершины острия F) в пределах двух порядков при сохранении фокусировки ионов с постоянной энергией на выходной щели источника. Это обеспечивало постоянную чувствительность и точность измерения ионного тока в широком диапазоне изменения испаряющих полей. Температуры эмиттера Т определялись с помощью американского оптического пирометра с исчезающей нитью PYRO с точностью измерения  $\pm 5^{\circ}$  и сами приведенные величины Т представляют собой средние величины из нескольких измерений. Вакуум в этом приборе был не слишком высоким  $p \sim 10^{-8}$  Torr, однако это не имело принципиального значения при проведении экспериментов при высоких T ~ 2000 К. Сочетание микроскопических и масс-спектрометрических методов оказалось эффективным, поскольку микроскопические методики позволяли изучать состояние поверхности посредством ее наблюдения с высоким пространственным разрешением, а масс-спектрометрические — определять ее состав посредством проведения масс- анализов испаряемых ионов.

# Экспериментальные результаты и их обсуждение

Как уже отмечалось, в случае полевого испарения при криогенных температурах наблюдаются ионы высоких зарядов, вольфрам испаряется в основном в виде ионов  $W^{+3}$ , меньше наблюдается ионов  $W^{+2}$  и совсем мало ионов W<sup>+4</sup>. Однако если проводить процесс полевого испарения при достаточно высоких Т эмиттера, то ситуация становится принципиально иной. Нами, как уже отмечалось, были проведены исследования полевого испарения некоторых металлов и сплавов при высоких Т и основной характерной особенностью процесса испарения было резкое понижение заряда испаряемого иона с ростом Т эмиттера. Проведенные нами эксперименты по полевому испарению при различных высоких T и  $F_{ev}$ показали, что и в нашем случае при испарении W при комнатной T наблюдались также в основном ионы  $W^{+3}$ , а при T > 1000 К наблюдались только низкозарядные ионы W<sup>+</sup> и W<sup>+2</sup>, причем если до температуры эмиттера  $T\sim 2200\,\mathrm{K}$  преобладали двухзарядные ионы W<sup>+2</sup>, то при более высоких Т в ионном токе превалировали уже в основном однозарядные ионы W<sup>+</sup>.

На рис. 1 приведены гистограммы амплитуд ионного тока полевого испарения отдельных изотопов W при T = 2267 K и  $F_{ev} \sim 38$  V/nm для двухзарядных ионов W<sup>+2</sup>, а на рис. 2 приведены такие же гистограммы при тех же T и  $F_{ev}$  для однозарядных ионов W<sup>+</sup>. Получены эти гистограммы следующим образом. Прибор осуществлял примерно 200 сканов от массы 182 до массы 186, и детектор считал общее количество импульсов тока в секунду для всех 4 изотопов W. При этом величины импульсов были разными от нескольких ионов до нескольких сотен ионов, так как процесс испарения носит принципиально нестационарный характер.



**Рис. 1.** Гистограммы амплитуд ионного тока полевого испарения отдельных изотопов вольфрама для двухзарядных ионов  $W^{+2}$  при температуре эмиттера T = 2267 К и напряженности испаряющего поля  $F_{ev} \sim 38$  V/nm. Широкие столбики без штриховки — экспериментально наблюдаемые ионы данной массы, узкие столбики с косой чертой — природное распределение изотопов по массам.



**Рис. 2.** Гистограммы амплитуд ионного тока полевого испарения отдельных изотопов вольфрама для однозарядных ионов  $W^{+2}$  при температуре эмиттера T = 2267 К и напряженности испаряющего поля  $F_{ev} \sim 38$  V/nm. Широкие столбики без штриховки — экспериментально наблюдаемые ионы данной массы, узкие столбики с косой чертой — природное распределение изотопов по массам.

Затем количество ионов каждого заряда для каждого изотопа усреднялось и определялось среднеквадратичное отклонение, которое и есть погрешность каждого такого измерения и, как правило, чем больше величина тока, тем больше и его флуктуации, величина этого отклонения и показана на гистограммах в виде "усовgrqq. Гистограммы на рис. 1 показывают, что и при такой высокой T наблюдается испарение всех четырех изотопов W и наблюдаемое распределение всех изотопов по массам для двузарядных ионов примерно соответствует стандартному изотопному отношению для природного W, т.е. доля ионов соответствующего изотопа в общем ионном токе примерно соответствует доле этого изотопа в стандартном изотопном отношении. Однако, как показали многочисленные эксперименты, вследствие флуктуационного характера процесса испарения количество зарегистрированных ионов того или иного изотопа может не всегда совпадать с природным изотопным составом W, если статистика ионов набрана недостаточная. Подобную картину показывает представленная на рис. 2 гистограмма амплитуд ионного тока полевого испарения однозарядных ионов W<sup>+</sup>. Полученная при той же  $T = 2267 \, {\rm K}$  она также демонстрирует испарение ионов всех 4 изотопов, но при этом вследствие характера процесса количество наблюдаемых в данном эксперименте ионов изотопа средней массы <sup>183</sup>W<sup>+</sup> значительно меньше количества, соответствующего стандартному изотопному распределению, а для ионов самого тяжелого изотопа <sup>186</sup>W<sup>+</sup> наблюдается обратная картина количество регистрируемых ионов <sup>186</sup>W<sup>+</sup> в несколько раз больше количества, соответствующего стандартному изотопному отношению. Значительный разброс данных, показанный в виде "усов" на рис. 1 и 2 объясняется, как уже отмечалось, флуктуационным, нестабильным характером самого процесса высокотемпературного полевого испарения, когда при испарении наблюдается так называемый "эффект схлопывания колец" — процесс периодического образования и испарения в виде ионов заметных кристаллических наростов на плотноупакованных гранях поверхности эмиттера, образующихся и испаряющихся вследствие процессов полевой диффузии, полевого кристаллического роста и полевого испарения [10]. Данные кристаллические наросты покрыты так называемыми термополевыми наноразмерными выступами конической формы и весьма малого радиуса кривизны  $r \sim 1-2$  nm, с вершин которых, где величина Fev максимальна, и происходит процесс испарения ионов. Полевые электронные изображения поверхности W, покрытой различным количеством таких нановыступов, и показаны на рис. 3. На рис. 3, а представлено изображение, соответствующее поверхности чистого W, а рис. 3, *b*-*d* — изображения поверхности W-эмиттера после одновременного воздействия одной и той же  $T = 2300 \,\mathrm{K}$  и различных величин  $F_{ev}$ . Меняя величину Fev при неизменной T эмиттера, можно менять количество эмиттирующих нановыступов на поверхности [11]. При этом ионный ток носит пульсирующий характер даже при постоянном приложенном напряжении, постоянном испаряющем поле и температуре. Таким образом, полевые ионные источники, использующие испарение при высоких Т, несомненно обладают преимуществами по сравнению с источниками, работающими при криогенных Т, поскольку имеют значительно больший ресурс работы и долговечность, однако естественным их недостатком является тот факт, что эмитируемый ими эмиссионный ионный ток является в принципе нестабильным и сильно флюктуирующим особенно при работе в стационарном режиме.



**Рис. 3.** Полевые электронные изображения поверхности W-эмиттера в случае одновременного воздействия на эмиттер температуры T = 2300 K и различных величин испаряющего поля  $F_{ev}$ : a - чистый W; b - после воздействия при T = 2300 K и  $F_{ev} \sim 40$  V/nm; c - после воздействия при T = 2300 K и  $F_{ev} \sim 37$  V/nm; d - после воздействия при T = 2300 K и  $F_{ev} \sim 32$  V/nm.

Для понимания характера процесса полевого испарения при высоких Т очень важно определить реальную величину  $F_{ev}$ , которая действует непосредственно в процессе испарения при высоких Т, поскольку именно она главным образом и определяет характер процесса. Обычно данную величину определяли косвенным методом. Вначале после достижения стационарного состояния ионной эмиссии при высоких T и Fev резко выключали нагрев эмиттера и "замораживали" ситуацию на поверхности при приложенном электрическом поле, а затем определяли величину  $F_{ev}$  на основе эмиссионных характеристик Фаулера-Нордгейма, которые получались уже при комнатной Т. Нами в работах [12,13] предложен другой метод определения величины F<sub>ev</sub>, который позволяет определить такую величину Fev, которая действует непосредственно в процессе высокотемпературного полевого испарения, данным методом мы и воспользуемся. Предположим, что и в случае испарения вольфрама зависимость скорости полевого испарения (т.е. ионного тока i) от T характеризуется обычным законом Аррениуса, только величина энергии активации испарения меняется в зависимости от величины напряженности приложенного электрического поля  $F_{ev}$ , тогда, согласно [2], полагаем, что величина ионного тока полевого испарения определяется выражением

$$i = v_0 \exp(-Q_n/kT),\tag{1}$$

где  $v_0$  — предэкспоненциальный множитель, а  $Q_n$  — энергия активации испарения *n*-кратно заряженного иона. Выражение же для  $Q_n$  удобно представить в

следующем виде:

$$Q_n = \lambda_0 + \sum I_n - n\varphi - 1.2n\sqrt{nF} + 3.45 \cdot 10^{-7} \alpha F^2, \quad (2)$$

где  $\lambda_0$  — теплота испарения материала эмиттера,  $I_n$  — потенциал ионизации *n*-кратно заряженного иона,  $\varphi$  — работа выхода эмиттера и  $\alpha$ — поляризуемость иона. При такой записи выражения величина  $Q_n$  получается непосредственно в eV, если величина  $F_{ev}$  определяется в V/nm, а величина  $\alpha$  — в nm<sup>3</sup>. Как было нами показано в работах [11,12], если зафиксировать при какойлибо *T* эмиттера равенство ионных токов W<sup>+2</sup> и W<sup>+</sup>, то можно получить универсальное выражение для оценки величины напряженности испаряющего электрического поля  $F_{ev}$  для процесса высокотемпературного полевого испарения, поскольку при этом величины Q<sub>1</sub> = Q<sub>2</sub> и, пренебрегая в выражении (2) последним членом с поляризацией, получаем

$$F_{ec} = \left[ (I_2 - \varphi)/2.19 \right]^2.$$
(3)

Подобное равенство ионных токов одно- и двухзарядных ионов будет наблюдаться практически всегда, поскольку при более низких Т преобладают ионы W<sup>+2</sup>, а при более высоких — наоборот ионы  $W^+$ , и кривые токов i(T) обязательно пересекаются. В случае полевого испарения W эти кривые ионных токов пересекаются в точке T = 2200 К. Подставляя соответствующие для W величины второго потенциала ионизации  $I_2 = 18 \,\mathrm{eV}$  и работы выхода  $\varphi = 4.5 \,\mathrm{eV}$ , мы получим величину напряженности испаряющего поля  $F_{ev} = 38 \,\mathrm{V/nm}$ , которая оказывается заметно меньше величин  $F_{ev} = 55-57 \text{ V/nm}$ , полученных для случая испарения W при криогенных T [1]. При этом необходимо отметить, что подобный метод определения (оценки) величины Fev имеет ограничения. Он позволяет определять реальную величину  $F_{ev}$ , только при той температуре, при которой равны токи одно- и двухзарядных ионов. Хотя состояние поверхности эмиттера в процессе полевого испарения при высоких Т динамически меняется, однако средние величины напряженности испаряющего поля Fev меняются при этом не сильно.

#### Заключение

Таким образом, основными выводами работы являются следующие:

1. В процессе полевого испарения вольфрама при высоких  $T \ge 2000$  К наблюдаются только ионы низких зарядов — W<sup>+</sup> и W<sup>+2</sup>, причем чем выше *T*, тем большую долю ионного тока составляют однозарядные ионы W<sup>+</sup>.

2. В процессе испарения наблюдаются ионы всех четырех основных изотопов W, и амплитуды пиков в масс-спектре изотопов W примерно соответствуют стандартному изотопному отношению для природного W, хотя иногда и наблюдаются отклонения от стандартного отношения как в большую, так и в меньшую стороны

для некоторых изотопов вследствие флуктуаций и нестабильного характера процесса испарения.

3. Исследуя зависимости величин ионного тока для ионов разных зарядов от температуры эмиттера T — кривые i(T), можно определить величину напряженности испаряющего поля  $F_{ev}$  непосредственно для условий испарения, зафиксировав точку пересечения этих кривых для одно- и двухзарядных ионов. Данная величина  $F_{ev}$  для случая полевого испарения W при T = 2200 K составляет  $F_{ev} = 38$  V/nm, что много меньше величин  $F_{ev} = 55-57$  V/nm, которые характерны для случаев полевого испарения X при F1,2].

# Список литературы

- [1] *Мюллер Э.В., Цонь Т.Т.* // Автоионная микроскопия. М.: Металлургия, 1972. 360 с.
- [2] Мюллер Э.В., Цонг Т.Т. // Полевая ионная микроскопия, полевая ионизация, полевое испарение. М.: Наука, 1980. 217 с.
- [3] Голубев О.Л., Блашенков Н.М., Логинов М.В. // Письма в ЖТФ. 2010. Т. 36. Вып. 20. С. 43–49.
- [4] *Толстогузов А.Б.* // Масс-спектрометрия. 2009. Т. 6. Вып. 4. С. 280–288.
- [5] Голубев О.Л., Блашенков Н.М., Лаврентьев Г.Я. // Письма в ЖТФ. 2006. Т. 32. Вып. 20. С. 46–51.
- [6] Голубев О.Л., Блашенков Н.М., Лаврентьев Г.Я. // ЖТФ. 2007. Т. 77. Вып. 10. С. 11–15.
- [7] Голубев О.Л., Блашенков Н.М., Логинов М.В. // ЖТФ. 2012. Т. 82. Вып. 3. С. 111–116.
- [8] Шредник В.Н. // Ненакаливаемые катоды. М.: Сов. радио, 1974. 335 с.
- [9] Бакулина И.Н., Блашенков Н.М., Ионов Н.И., Лаврентьев Г.Я., Шустров Б.Н. // А.с. № 711935. БИ. 1987. № 48.
- [10] Бутенко В.Г., Голубев О.Л., Конторович Е.Л., Шредник В.Н. // Письма в ЖТФ. 1992. Т. 18. Вып. 8. С. 86–91.
- [11] Голубев О.Л., Ивченко В.А. // Письма в ЖТФ. 2012. Т. 38. Вып. 20 С. 63–68.
- [12] Голубев О.Л., Блашенков Н.М. // Письма в ЖТФ. 2016. Т. 42. Вып. 14. С. 80–86.
- [13] Голубев О.Л., Блашенков Н.М. // ЖТФ. 2017. Т. 87. Вып. 8. С. 1238–1242.